

開放機器一覧 2020

●測定系

形状測定	機器名称	使用単位	使用料
X線CT装置		時間	2,210
高精度三次元測定機		時間	3,370
高精度表面粗さ形状測定機		時間	1,130
触針式表面形状測定機		時間	530
真円度測定機		時間	1,060
ステップゲージ(※)		日	880
測定顕微鏡		時間	380
ビデオプローブ式三次元測定機		時間	1,360
ブロックゲージ		時間	400
レーザー式運動精度測定装置(※)		時間	610
温度・熱流体測定			
可視・熱画像測定用小型カメラ(※)		時間	390
携行型赤外線映像装置(※)		時間	440
高速度赤外線サーモグラフィ(※)		時間	1,580
赤外線検知式温度計(※)		時間	400
赤外線熱画像装置(※)		時間	560
標準温度計(※)		時間	390
露点計		時間	430
音・振動・力・ひずみ測定			
音響パワーレベル測定システム		時間	570
振動測定装置(※)		時間	430
切削動力計(3分力/4分力)(※)		時間	550
騒音計(※)		時間	420
ハンドヘルド振動計(※)		時間	450
ひずみ測定機(※)		時間	420
無響室		時間	760
レーザードップラー式振動計(※)		時間	520
電気・電子測定			
FFTアナライザー(※)		時間	430
LCRメーター(※)		時間	390
オシロスコープ(※)		時間	400
組込みソフトウェアデバッガー(※)		時間	420
クランプ電力計(※)		時間	380
小型データロガー(※)		日	600
GMサーベイメータ(※)		時間	380
スペクトラム・インピーダンスアナライザー(※)		時間	550
抵抗計(※)		時間	390
低抵抗率計(※)		時間	380
データロガー(※)		日	920
電子負荷装置(※)		時間	390
電力計(※)		時間	380
任意波形発生器(※)		時間	390
マルチメーター(※)		時間	380
ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)		時間	480
リアルタイムスペクトラムアナライザー		時間	520
ロジックアナライザー		時間	390
電磁環境測定			
雷サージ耐性試験機		時間	510
簡易ノイズ測定機(※)		時間	380
静電気耐性試験機		時間	510
電磁干渉試験機(エミッション)		時間	1,050
電磁耐性試験機(イミュニティ)		時間	960
電波暗室		時間	1,180
ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ)		時間	540
ノイズ耐性試験システム(静電気)		時間	470
ノイズ耐性試験システム(電源変動)		時間	500
ファーストランジェント・バースト耐性試験機		時間	510
光・色彩測定			
LED寿命試験装置		時間	720
大型積分球全光束測定装置		時間	1,450
輝度・照度自動マッピング測定装置		時間	690
小型全光束測定装置		時間	1,430
照度マッピング測定装置		時間	660
照明設計シミュレータ		時間	850
配光測定装置		時間	510
光散乱特性評価装置		時間	1,250
分光測色計(デスクトップ)		時間	560
分光測色計(ハンディ)(※)		時間	440
分光放射輝度計(※)		時間	510
ライトメーター(※)		時間	380

(消費税10%込)

人間工学測定	機器名称	使用単位	使用料
血流画像装置(※)		時間	520
レーザー血流量計(※)		時間	580
無線式生体計測装置(※)		時間	900
生体信号計測装置(BIOPAC)(※)		時間	380
体圧分布測定器(※)		時間	620

●分析系

表面観察・分析	機器名称	使用単位	使用料
カラーレーザー顕微鏡		時間	1,050
蛍光顕微鏡		時間	450
実体顕微鏡		時間	450
生物顕微鏡システム		時間	460
走査型プローブ顕微鏡		時間	820
低真空走査電子顕微鏡		時間	2,030
デジタルマイクロスコープ		時間	560
倒立型金属顕微鏡		時間	510
フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡		時間	3,580
フィールドエミッション走査電子顕微鏡		時間	3,340
有機分析			
FT-IRマイクロATRシステム		時間	1,150
カールフィッシャー式水分測定装置(※)		時間	400
ガスクロマトグラフ(アジレント)		時間	1,370
ガスクロマトグラフ(島津製作所)		時間	910
ガスクロマトグラフ質量分析装置(材料系)		時間	2,370
高温GPC◎		時間	4,320
紫外・可視分光光度計(材料系)		時間	510
マイクロ波透過式水分計(※)		時間	430
無機分析			
X線回折装置		時間	3,710
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計)		時間	440
グロー放電発光表面分析装置		時間	4,570
蛍光X線分析装置(EDXRF)		時間	1,010
蛍光X線分析装置(WDXRF)		時間	1,740
蛍光X線膜厚計		時間	710
全窒素分析装置		時間	560
炭素硫黄同時分析装置		時間	710
熱膨張率測定装置		時間	760
ラマン分光光度計		時間	1,190
食品分析			
ICP発光分光分析装置		時間	2,640
味認識装置◎		試料	2,260
アミノ酸分析装置		試料	1,720
キャピラリー式電気泳動分析装置		時間	610
クリーンベンチ		時間	450
ケルダール分析装置		バッチ(20本)	2,300
高速液体クロマトグラフ(食品系)		時間	860
高速液体クロマトグラフ(有機酸分析システム)		時間	1,090
高速冷却遠心機		時間	570
紫外・可視分光光度計(食品系)		時間	490
振動密度計		時間	840
水分活性測定装置		時間	420
ソックスレー抽出器		試料	1,240
におい識別装置◎		時間	1,940
燃焼式窒素分析装置		時間	2,890
マイクロ波加熱分解装置		時間	790
マイクロプレートリーダー		時間	470
レオメーター		時間	500

●試験系

材料強度・衝撃試験		
機器名称	使用単位	使用料
アイソット・シャルピー衝撃試験機	時間	830
小型引張圧縮試験機	時間	690
精密小型引張圧縮試験機	時間	1,340
万能材料試験機 (1000kN)	時間	1,560
万能材料試験機 (500kN)	時間	550
引張圧縮試験機	時間	1,390
材料硬さ・摩耗試験		
往復運動平面摩耗試験機	時間	410
超微小押し込み硬さ試験機	時間	1,310
薄膜用摩擦摩耗試験機 (TRIBOMETER/HT)	時間	600
薄膜用摩擦摩耗試験機 (UMT-TriboLab)	時間	810
反発式ポータブル硬度計(※)	時間	430
微小硬度計	時間	640
ピッカース硬度計	時間	490
ブリネル硬度計	時間	550
摩擦摩耗試験機	時間	650
ロックウェル硬度試験機	時間	630
材料物性試験		
X線応力測定装置	時間	660
干渉膜厚計	時間	1,000
磁気応力測定装置(※)	時間	380
自動分極装置	時間	670
接触角計	時間	450
電磁式ふるい振とう機	時間	510
熱線式熱伝導率測定装置(※)	時間	460
熱分析装置 (DSC・DMA・TMA) 旧:粘弾性測定装置	時間	820
熱分析装置 (TG-DTA)	時間	1,060
メルトインデクサー	時間	660
溶射皮膜密着力試験機	時間	490
レーザー回折粒度分布測定装置	時間	620
環境試験		
大型複合環境試験機 (振動試験機・恒温槽同時使用) ◎	時間	1,760
大型複合環境試験機 (振動試験機) ◎	時間	1,230
大型複合環境試験機 (恒温槽) ◎	日	11,510
小型冷熱衝撃試験機	時間	660
人工気象室	日	39,860
低速風洞	時間	1,380
複合環境試験機 (振動試験機・恒温槽同時使用)	時間	1,460
複合環境試験機 (振動試験機)	時間	940
複合環境試験機 (恒温槽)	日	10,050
複合サイクル試験機	日	4,150

●加工系

機械加工		
機器名称	使用単位	使用料
形彫り放電加工機	時間	1,170
高精度研磨装置	時間	540
精密平面研削盤	時間	1,040
旋盤	時間	670
立形マシニングセンター	時間	1,270
直立ボール盤	時間	520
鋸盤	時間	400
ハイスピードミーリングセンター	時間	1,830
フライス盤	時間	450
平面研削盤	時間	630
細穴放電加工機	時間	530
ワイヤー放電加工機	時間	1,370
材料加熱処理・恒温槽		
恒温恒湿器	日	2,140
高速昇温加熱炉 (酸化雰囲気)	時間	670
高速昇温加熱炉 (不活性雰囲気)	時間	830
真空凍結乾燥機	日	3,950
定温乾燥機	時間	440
定温乾燥器 (ETTAS)	日	620
放電プラズマ焼結機	時間	3,680
材料表面処理		
イオンミリング装置	時間	1,510
真空蒸着装置	時間	580
スパッタリング装置	日	12,360
超臨界処理装置	時間	620
反応スパッタリング装置	日	11,200

使用料の単位は円、使用料には消費税10%が含まれます。
 県外(中国地域を除く)からのご利用は、料金が2倍となります。
 ◎は県内・県外同一料金です。
 (※)は当センター施設外への持ち出しが可能です。 使用単位:1日(8時間)

(消費税10%込)

材料加工 (粉碎・混練・成形・研磨)		
機器名称	使用単位	使用料
ガラスビード作製装置	時間	820
金属研磨装置	時間	890
減容混練押出機	時間	850
ジェットミル	時間	640
試験片加工機	時間	490
試料自動埋込機	時間	440
卓上射出成形機	時間	780
ディスクミル	時間	530
ニーダー	時間	510
破碎機	時間	620
ハンシェルミキサー	時間	430
ボールミル	時間	420
マイクローム	時間	770
遊星ボールミル	時間	610
冷間等方加圧装置	時間	810
ワイゼンベルグ混練押出し機	時間	450
電子・基板加工		
電子回路基板加工機	時間	640
ドライフィルムラミネーター	時間	850
表面実装装置 (印刷機)	時間	520
表面実装装置 (マウンタ)	時間	520
表面実装装置 (リフロー)	時間	570
マスクアライナー	時間	1,200
食品加工		
遠赤外線食品乾燥機	日	700
オートクレーブ	時間	410
過熱蒸気発生装置	時間	620
乾湿球温度制御乾燥機	日	1,010
シャーファーマンター	日	5,230
真空乾燥機	日	1,900
真空凍結食品乾燥機	日	4,100
真空濃縮装置	時間	740
スプレードライヤー	時間	470
超微粒粉碎機	時間	450
通風乾燥機	日	770
電気恒温槽 (KENIS/YAMATO)	日	580
電気炉 (食品用)	日	600
ドラム式食品乾燥装置	時間	620
二軸エクストルーダー	時間	630
バイオシェーカー	日	640
フレンチプレス	時間	500
ボールカッター	時間	530
レトルト殺菌装置	時間	810

●設計・造形・撮影

3Dデータ作成・造形・構造解析		
機器名称	使用単位	使用料
インクジェット式光造形機	時間	1,400
機械設計支援システム (CAD・構造・流体・機構)	時間	590
機械設計支援システム (構造最適化) ◎	時間	1,720
CAMシステム	時間	760
金属積層造形機	時間	4,010
小型レーザー加工機	時間	1,170
樹脂積層式造形機	時間	1,370
真空注型システム (乾燥炉)	日	1,870
真空注型システム (真空注型機)	時間	1,070
3D-CAD	時間	820
3Dスキャナー (光学縞投影)	時間	770
3Dスキャナー (ハンディ) (※)	時間	690
3D点群データ処理装置	時間	540
制御系設計支援システム	時間	580
切削式3Dモデリング装置	時間	670
造形データ処理システム	時間	430
粉末焼結式樹脂造形機◎	時間	3,070
撮影		
高速度ビデオカメラ(※)	時間	430
撮影スタジオ	時間	520
長距離顕微鏡(※)	時間	380

●その他

文献検索		
機器名称	使用単位	使用料
JDreamⅢ文献検索端末	-	無料